

第66回応用物理学会春季学術講演会シンポジウム

S17 : 先端イオン顕微鏡技術の
ナノスケール材料・デバイスへの展開
2019年3月11日(月) 13:30 ~ 東京工業大学 大岡山キャンパス

新たなイオン顕微鏡技術を理解し、今後の材料、デバイスの研究開発への有効活用を促し、イオン顕微鏡技術、材料・デバイス技術の研究開発を加速することを目的として、最新のガスイオン顕微鏡など先端顕微鏡技術を用いた研究成果を広くわかりやすく議論します。

基本は英語ですが、日本語大歓迎、一般講演も受け付けています。
イオン顕微鏡って何?、という人も是非ご参加ください!!

世話人:小川真一(産総研)、米谷玲皇(東大)

講演の一部

1. New routes and paradigms in Device Engineering for Nanoelectronics and Nanosystems
Simon Deleonibus (LETI)
2. Current status of high resolution in situ and environmental TEM studies of material reactions
Robert Sinclair (Stanford University)
3. Single-nanometer phononic crystals patterned on suspended graphene by using helium ion beam
Hiroshi Mizuta (JAIST)
4. Nano Superconducting Quantum Interference Devices via Direct-write Helium Ion Lithography
Shane Cybart (UC Urvin)
5. Electron microscopy of samples in liquid and ice, and correlated Helium ion microscopy
Chikara Sato (AIST)
6. Realization of nanophotonic quantum devices using a He ion microscope
Hideaki Takashima (Kyoto University)
7. NanoFabrication on Thin Films with Light Ions
John Notte (Carl Zeiss)

